

DOI: https://doi.org/10.30898/1684-1719.2024.8.8 УДК: 53.083.2; 53.082.73

ЭЛЕКТРОУПРУГОСТЬ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПЛЕНОЧНОГО АКТЮАТОРА С СИСТЕМОЙ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ВСТРЕЧНО-ГРЕБЕНЧАТЫХ ЭЛЕКТРОДОВ

А.А. Паньков

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 614990, Пермь, Комсомольский пр-кт, д. 29

Статья поступила в редакцию 18 мая 2024 г.

Разработана Аннотация. электромеханическая математическая модель пьезоэлектрического CDS-актюатора функционирования В виде пьезоэлектрической цилиндрической оболочки с двойными спиралями взаимодействующих электродов, установленных на поверхности оболочки. Предложен способ изготовления пьезоэлектрического CDS-актюатора через предварительное создание развертки CDS-актюатора В виле гибкого планарного прямоугольного пьезоэлектрического актюатора с расположением взаимодействующих прямолинейных «встречно-гребенчатых» электродов под углом к основанию CDS-развертки. Осуществлено численное моделирование деформационных полей и модальный анализ первых трех форм и резонансных частот колебаний для однослойного и двухслойного CDS-актюаторов.

Ключевые слова: пьезоэлектрический CDS-актюатор, двойная спираль электродов, электроупругость, модальный анализ, численное моделирование.

Финансирование: Результаты получены при выполнении государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на выполнение фундаментальных научных исследований (проект № FSNM-2023-0006).

Автор для переписки: Паньков Андрей Анатольевич, a_a_pankov@mail.ru

Введение

Гибкие пленочные пьезоэлектрические элементы используются В качестве генераторов электрической энергии [1-3], датчиков и актюаторов – пьезоэлектрических преобразователей электрических сигналов от источника питания в движение исполнительных элементов для манипулирования или микромасштабных объектов [4-12], В сборки частности, В качестве двигателей, [9], пьезоэлектрических шаговых микрозахватов элементов управления геометрией отражающих [6] или аэродинамических [10-12] поверхностей в современных микроэлектромеханических системах (МЭМС), системах автоматического управления радиотехники, электроники, оптики, аэрокосмической и медицинской техники. Широкое применение в различных областях науки и, в частности, аэрокосмической техники находят современные MFC-актюаторы [13], которые состоят из композитного пьезоэлектрического слоя В близко виле уложенных В один ряд однонаправленных пьезокерамических (PZT-5A) волокон в полимерном (эпоксидном) связующем. На верхней и нижней поверхности пьезоэлектрического слоя установлены пленочные «встречно-гребенчатые» взаимодействующие электроды (IDE), расстояния между соседними разнонаправленными прямолинейными узкими тонкими полосками электродов 0,5 мм, при этом полная толщина такого пленочного MFC-актюатора 0.3 мм [14-17]. Дополнительное улучшение рабочих характеристик MFC-актюатора возможно посредством использования монокристаллических пьезоэлектрических волокон [15] вместо традиционно поликристаллических пьезоэлектрических используемых волокон в композитном пьезоактивном слое актюатора. По аналогии с устройством мембранные MFC-актюатора В [16, 17] предложены (MDS) [16] И цилиндрические (CDS) [17] пьезоэлектрические актюаторы с двойными (плоской или цилиндрической) спиралями электродов, взаимодействующих пьезоэлектрический (плоской или цилиндрической) через слой c взаимообратной поляризацией, соответственно. Способ изготовления пьезоэлектрического CDS-актюатора [18] с углом подъема спирали α

гибкого предполагает предварительное изготовление планарного прямоугольного пьезоэлектрического актюатора (как развертки CDSактюатора) с расположением взаимодействующих прямолинейных «встречногребенчатых» электродов под углом а к основанию актюатора на одной или обоих (верхней и нижней) поверхностях тонкого пьезоэлектрического слоя с последующим сворачиванием полученного планарного актюатора В цилиндрическую оболочку с установкой, например, на поверхности упругого вала (подложки).

Цель – разработка математической модели, численное моделирование деформационных полей и модальный анализ пьезоэлектрических CDS-актюаторов [18] с двухзаходными (двойными) спиралями взаимодействующих поверхностных электродов.

1. Способ создания CDS-актюатора

Способ изготовления пьезоэлектрического CDS-актюатора [17] включает нанесение двух токопроводящих систем электродных ленточных покрытий (противоположно друг другу) на одной или обоих (верхней и нижней) поверхностях тонкого пьезоэлектрического слоя прямоугольной формы (рис. 1а) с последующим сворачиванием полученного планарного актюатора в цилиндрическую оболочку (рис. 1б).



Рис. 1. Пластинчатый актюатор [18] (а) как развертка цилиндрического CDS-актюатора [17] (б).

Взаимообратную поляризацию пьезоэлектрического слоя осуществляют посредством приложения К выходам различных систем электродов поляризующего электрического напряжения. В частности, наносят электродные ленточные покрытия на верхнюю и нижнюю поверхности пьезоэлектрического слоя прямоугольной формы в виде множества параллельных прямолинейных чередующихся четных и нечетных отрезков электродов с заданным малым ориентационным углом шагом И заданным К основанию периметра пьезоэлектрического слоя. Далее, верхнюю нижнюю стороны на И пьезоэлектрического слоя вдоль прямолинейных участков его периметра наносят два линейных базовых электрода, не контактирующие между собой и каждый из которых соединяет собой окончания соответственно четных и нечетных отрезков электродов, с образованием двух двухсторонних систем электродов с двумя выходами для подключения управляющего электрического напряжения U_{con}. Взаимообратная поляризация пьезоэлектрического слоя (рис. 2) осуществляется посредством приложения к выходам электродов поляризующего электрического напряжения Upol. Пьезоэлектрический слой полимерного может быть изготовлен ИЗ композиционного материала, армированного продольно поляризованными пьезоэлектрическими волокнами (монокристаллами) ортогонально направлению параллельных отрезков электродов.



Рис. 2. Расположения электродов на верхней и нижней поверхностях и направления поляризаций **р** в продольном сечении пьезоэлектрического слоя актюатора.

Пьезоэлектрический цилиндрический CDS-актюатор (рис. 1б) получают в результате сворачивания полученного планарного актюатора (рис. 1а) как развертки в цилиндрическую оболочку, в частности, с использованием цилиндрической подложки И соединения контактирующих торцов пьезоэлектрического слоя адгезионной клеевой прослойкой вдоль образующей цилиндрической оболочки с выполнением условия отсутствия электрического контакта между электродами различных двухсторонних систем электродов. Целесообразно нанесение на пьезоэлектрический актюатор внешнего защитного электроизоляционного покрытия.

2. Электро-механическая математическая модель актюатора

2.1 Определяющие соотношения. Рассмотрим упругое деформирование пьезоэлектрической анизотропной развертки (рис. 1а, рис. 3а) тонкого пленочного CDS-актюатора – тонкой цилиндрической оболочки (рис. 1б, рис. 3б) с геометрическими параметрами: R – средний радиус, h – высота, h_a – малая толщина цилиндрической оболочки (актюатора) под действием приложенного к его электродам управляющего электрического напряжения U_{con} .



Рис. 3. Пьезоэлектрическая деформация развертки (а) тонкого пленочного цилиндрического CDS-актюатора (б) с поляризацией **p** по оси ξ₃ и ориентацией линейных электродов по оси ξ₁.

<u>ЖУРНАЛ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, eISSN 1684-1719, №8, 2024</u>

Учитываем лишь обратный пьезоэффект, что соответствует подходу термоаналогии [19], считая несущественным влияние деформирования ε на электрическую напряженность \hat{E} внутри актюатора по сравнению с существенно большим значением $\hat{E}_{\xi 3} \approx \hat{E}_{con} = U_{con} / \Delta$ управляющей электрической напряженности, при этом $\hat{E}_{\xi 1} = \hat{E}_{\xi 2} \approx 0$, ось поляризации ξ_3 . Определяющие соотношения для пьезоэлектрического слоя -

$$\sigma_{ij} = c_{ijmn} \varepsilon_{mn} - e_{nij} \widehat{E}_n, \ \varepsilon_{ij} = s_{ijmn} \sigma_{mn} + d_{nij} \widehat{E}_n,$$
(1)

где σ , ε – тензоры напряжений и деформаций, \hat{E} – вектор напряженности электрического поля, c, $s \equiv c^{-1}$ – взаимообратные тензоры упругих жесткостей и податливостей, e, d – тензоры пьезоэлектрических модулей, при этом $d_{nij} \equiv s_{ijpq} e_{npq}$. Электроупругие свойства пьезоэлектрического слоя считаем трансверсально-изотропными с характеристиками керамики PZT-5, для которой матрицы упругих и пьезоэлектрических модулей

$$\|c_{\xi ij}\| = \begin{pmatrix} c_{\xi 11} & c_{\xi 12} & c_{\xi 13} & 0 & 0 & 0 \\ c_{\xi 12} & c_{\xi 11} & c_{\xi 13} & 0 & 0 & 0 \\ c_{\xi 13} & c_{\xi 13} & c_{\xi 33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_{\xi 44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{\xi 44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{\xi 44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{\xi 46} \\ \end{pmatrix}, \ \|e_{\xi ij}\| = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & e_{\xi 15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e_{\xi 15} & 0 & 0 \\ e_{\xi 31} & e_{\xi 31} & e_{\xi 33} & 0 & 0 & 0 \\ e_{\xi 31} & e_{\xi 33} & 0 & 0 & 0 \\ \end{pmatrix}$$
(2)

в главных координатных осях $\xi_{1,2,3}$, где ξ_3 – ось симметрии (поляризации) электроупругих свойств (рис. 3а), тензорные и матричные индексы связаны между собой соотношениями: 11 \rightarrow 1, 22 \rightarrow 2, 33 \rightarrow 3, 23 и 32 \rightarrow 4, 13 и 31 \rightarrow 5, 12 и 21 \rightarrow 6.

Компоненты трансверсально-изотропного тензора упругих свойств С в координатных осях r_i представим разложениями

$$c_{ijmn} = \sum_{p=1}^{6} c_{(p)} T_{(p)ijmn} , \qquad (3)$$

где

$$T_{(1)inkl} = a_{in}a_{kl}, T_{(2)inkl} = a_{in}d_kd_l, T_{(3)inkl} = a_{kl}d_id_n,$$

$$T_{(4)inkl} = d_i d_n d_k d_l , T_{(5)inkl} = a_{ik} a_{nl} + a_{il} a_{nk} ,$$

$$T_{(6)inkl} = a_{ik} d_n d_l + a_{il} d_n d_k + a_{nk} d_i d_l + a_{nl} d_i d_k ,$$
(4)

компоненты $a_{ij} = \delta_{ij} - d_i d_j$, пять независимых констант упругости:

$$c_{(1)} = c_{\xi 12}, \ c_{(2)} \equiv c_{(3)} = c_{\xi 13}, \ c_{(4)} = c_{\xi 33}, \ c_{(5)} = c_{\xi 66}, \ c_{(6)} = c_{\xi 55}, \ c_{\xi 11} = c_{(1)} + 2c_{(5)},$$

 δ – символ Кронекера, $c_{\xi 12}$, $c_{\xi 13}$, $c_{\xi 33}$, $c_{\xi 66}$, $c_{\xi 55}$ – независимые компоненты трансверсально-изотропного тензора с в матричной форме записи (2) в главных осях $\xi_{1,2,3}$, ξ_3 – ось симметрии. В рассматриваемом случае (рис. 3а) координаты направляющего вектора -

$$d_1 = -\sin\alpha, \ d_2 = 0, \ d_3 = \cos\alpha \tag{5}$$

для оси ξ_3 симметрии свойств и из формул (3) – (5) следуют выражения компонент тензора упругих свойств:

$$c_{1122} = c_{(1)} \cos^2 \alpha + c_{(3)} \sin^2 \alpha ,$$

$$c_{3322} = c_{(1)} \sin^2 \alpha + c_{(3)} \cos^2 \alpha ,$$

$$c_{1322} = \frac{1}{2} (c_{(1)} - c_{(3)}) \sin 2\alpha ,$$
(6)

где $c_{(1)} = c_{\xi 1122}$, $c_{(3)} = c_{\xi 1133}$ и дополнительно:

$$c_{1111} = (c_{(1)} + 2c_{(5)})\cos^{4}\alpha + c_{(4)}\sin^{4}\alpha + (c_{(2)} + c_{(3)} + 4c_{(6)})\sin^{2}\alpha\cos^{2}\alpha$$

$$c_{1133} = c_{(2)}\cos^{4}\alpha + c_{(3)}\sin^{4}\alpha + (c_{(1)} + c_{(4)} + 2c_{(5)} - 4c_{(6)})\sin^{2}\alpha\cos^{2}\alpha$$

$$c_{3313} = (c_{(1)} - c_{(2)} + 2c_{(5)} - 2c_{(6)})\sin^{3}\alpha\cos\alpha + (c_{(3)} - c_{(4)} + 2c_{(6)})\sin\alpha\cos^{3}\alpha$$

$$(7)$$

$$c_{3333} = (c_{(1)} + 2c_{(5)})\sin^{4}\alpha + c_{(4)}\cos^{4}\alpha + (c_{(2)} + c_{(3)} + 4c_{(6)})\sin^{2}\alpha\cos^{2}\alpha$$

$$c_{1311} = (c_{(2)} - c_{(4)} + 2c_{(6)})\sin^{3}\alpha\cos\alpha + (c_{(1)} - c_{(3)} + 2c_{(5)} - 2c_{(6)})\sin\alpha\cos^{3}\alpha$$

$$c_{1313} = c_{(6)}\cos^{2}2\alpha + \frac{1}{4}(c_{(1)} - c_{(2)} - c_{(3)} + c_{(4)} + 2c_{(5)})\sin^{2}2\alpha$$

при этом компонента

$$c_{2222} = c_{\xi 2222} = c_{(1)} + 2c_{(5)}$$

равна главному значению $c_{\xi^{2222}}$ (2).

2.2 Однослойная CDS-развертка. Для развертки цилиндрического однослойного CDS-актюатора (рис. 3) в условиях плоского напряженного состояния ($\sigma_{22} = 0$) имеем (1) деформации

$$\varepsilon_{11} = s_{1111}\sigma_{11} + s_{1133}\sigma_{33} + 2s_{1113}\sigma_{13} + (d_{\xi 333}\sin^2\alpha + d_{\xi 311}\cos^2\alpha)\frac{U_{\text{con}}}{\Delta},$$

$$\varepsilon_{33} = s_{3311}\sigma_{11} + s_{3333}\sigma_{33} + 2s_{3313}\sigma_{13} + (d_{\xi 333}\cos^2\alpha + d_{\xi 311}\sin^2\alpha)\frac{U_{\text{con}}}{\Delta},$$

$$\gamma_{13} \equiv 2\varepsilon_{13} = 2s_{1311}\sigma_{11} + 2s_{1333}\sigma_{33} + 4s_{1313}\sigma_{13} + \sin 2\alpha(d_{\xi 311} - d_{\xi 333})\frac{U_{\text{con}}}{\Delta},$$

(8)

при этом деформация по толщине слоя –

$$\varepsilon_{22} = s_{2211}\sigma_{11} + s_{2233}\sigma_{33} + 2s_{2213}\sigma_{13} + d_{\xi 322}\frac{U_{\text{con}}}{\Delta}$$

с учетом равенства $d_{\xi 322} = d_{\xi 311}$. Соответствующие величины напряжений –

$$\sigma_{11} = c_{1111}\varepsilon_{11} + c_{1122}\varepsilon_{22} + c_{1133}\varepsilon_{33} + c_{1113}\gamma_{13} - (e_{\xi_{333}}\sin^2\alpha + e_{\xi_{311}}\cos^2\alpha)\frac{U_{\text{con}}}{\Delta},$$

$$\sigma_{33} = c_{3311}\varepsilon_{11} + c_{3322}\varepsilon_{22} + c_{3333}\varepsilon_{33} + c_{3313}\gamma_{13} - (e_{\xi_{333}}\cos^2\alpha + e_{\xi_{311}}\sin^2\alpha)\frac{U_{\text{con}}}{\Delta},$$
 (9)

$$\tau_{13} = c_{1311}\varepsilon_{11} + c_{1322}\varepsilon_{22} + c_{1333}\varepsilon_{33} + c_{1313}\gamma_{13} - \frac{1}{2}\sin 2\alpha(e_{\xi_{311}} - e_{\xi_{333}})\frac{U_{\text{con}}}{\Delta},$$

с учетом (1) и равенства

$$\sigma_{22} = c_{2211}\varepsilon_{11} + c_{2222}\varepsilon_{22} + c_{2233}\varepsilon_{33} + c_{2213}\gamma_{13} - e_{\xi_{322}}\frac{U_{\text{con}}}{\Delta} = 0$$
(10)

для рассматриваемого плоского напряженного состояния, $e_{\xi 322} = e_{\xi 311}$. Из (10) получим выражение деформации

$$\varepsilon_{22} = \frac{1}{c_{2222}} \left(e_{\xi_{311}} \frac{U_{\text{con}}}{\Delta} - c_{2211} \varepsilon_{11} - c_{2233} \varepsilon_{33} - c_{2213} \gamma_{13} \right)$$
(11)

после подстановки которого в (9) получим формулы для напряжений

$$\sigma_{11} = \left(c_{1111} - \frac{c_{1122}c_{2211}}{c_{2222}}\right) \mathcal{E}_{11} + \left(c_{1133} - \frac{c_{1122}c_{2233}}{c_{2222}}\right) \mathcal{E}_{33} + \left(c_{1113} - \frac{c_{1122}c_{2213}}{c_{2222}}\right) \gamma_{13} + \left(\frac{e_{\xi 311}c_{1122}}{c_{2222}} - e_{\xi 333}\sin^2\alpha - e_{\xi 311}\cos^2\alpha\right) \frac{U_{\text{con}}}{\Delta}$$

$$\sigma_{33} = \left(c_{3311} - \frac{c_{3322}c_{2211}}{c_{2222}}\right)\varepsilon_{11} + \left(c_{3333} - \frac{c_{3322}c_{2233}}{c_{2222}}\right)\varepsilon_{33} + \left(c_{3313} - \frac{c_{3322}c_{2213}}{c_{2222}}\right)\gamma_{13} + \left(\frac{e_{\xi 311}c_{3322}}{c_{2222}} - e_{\xi 333}\cos^{2}\alpha - e_{\xi 311}\sin^{2}\alpha\right)\frac{U_{\text{con}}}{\Delta}$$

$$\tau_{13} = \left(c_{1311} - \frac{c_{1322}c_{2211}}{c_{2222}}\right)\varepsilon_{11} + \left(c_{1333} - \frac{c_{1322}c_{2233}}{c_{2222}}\right)\varepsilon_{33} + \left(c_{1313} - \frac{c_{1322}c_{2213}}{c_{2222}}\right)\gamma_{13} + \left(\frac{e_{\xi 311}c_{1322}}{c_{2222}} + \frac{1}{2}(e_{\xi 333} - e_{\xi 311})\sin 2\alpha\right)\frac{U_{\text{con}}}{\Delta}$$

$$(12)$$

Блокирующие напряжения на сторонах прямоугольной однослойной развертки (рис. 3a) CDS-актюатора –

$$\sigma_{\bullet 11} = \left(e_{\xi 311} \frac{c_{1122}}{c_{\xi 2222}} - e_{\xi 333} \sin^2 \alpha - e_{\xi 311} \cos^2 \alpha \right) \frac{U_{\text{con}}}{\Delta},$$

$$\sigma_{\bullet 33} = \left(e_{\xi 311} \frac{c_{3322}}{c_{\xi 2222}} - e_{\xi 333} \cos^2 \alpha - e_{\xi 311} \sin^2 \alpha \right) \frac{U_{\text{con}}}{\Delta},$$

$$\tau_{\bullet 13} = \left(e_{\xi 311} \frac{c_{1322}}{c_{\xi 2222}} + \frac{1}{2} (e_{\xi 333} - e_{\xi 311}) \sin 2\alpha \right) \frac{U_{\text{con}}}{\Delta},$$

(13)

с учетом вида упругих компонент: c_{1122} , c_{3322} , c_{1322} (6) как функций угла α найдем из (12) для случая $\varepsilon_{11} = \varepsilon_{33} = \gamma_{13} = 0$.

Свободные деформации: $\varepsilon_{0.011}$, $\varepsilon_{0.033}$, $\gamma_{0.013}$ для случая $\sigma_{11} = \sigma_{33} = \tau_{13} = 0$ найдем из решения системы трех линейных уравнений (12) или напрямую из формул (8) в виде

$$\varepsilon_{\circ 11} = (d_{\xi 333} \sin^2 \alpha + d_{\xi 311} \cos^2 \alpha) \frac{U_{\text{con}}}{\Delta},$$

$$\varepsilon_{\circ 33} = (d_{\xi 333} \cos^2 \alpha + d_{\xi 311} \sin^2 \alpha) \frac{U_{\text{con}}}{\Delta},$$

$$\gamma_{\circ 13} = (d_{\xi 311} - d_{\xi 333}) \frac{U_{\text{con}}}{\Delta} \sin 2\alpha,$$
(14)

что соответствует радиальному $u_{\circ r}$ и продольному $u_{\circ z}$ смещениям и повороту $\Delta \varphi_{\circ z}$ вокруг оси *z* свободного кольцевого торца CDS-актюатора (рис. 3б)

$$u_{\circ r} = \varepsilon_{\circ 11} R, \ u_{\circ z} = \varepsilon_{\circ 33} h, \ \Delta \varphi_{\circ z} = \gamma_{\circ 13} \frac{h}{R}$$
(15)

с учетом равенств деформаций: $\mathcal{E}_{\circ \varphi \varphi} = \mathcal{E}_{\circ 11}, \quad \mathcal{E}_{\circ zz} = \mathcal{E}_{\circ 33}, \quad \gamma_{\circ \varphi z} = \gamma_{\circ 13}$ в цилиндрической системе координат.

2.3 Двухслойная CDS-развертка. Для двухслойной развертки составного CDS-актюатора со значениями U_{con1}, U_{con2} управляющих электрических напряжений и ориентационными углами α₁, α₂ = -α₁ линейных электродов соответственно для 1-го и 2-го слоя после осреднения левых и правых частей выражений (12) получим

$$\begin{aligned} < \sigma_{11} >= \left\langle c_{1111} - \frac{c_{1122}c_{2211}}{c_{2222}} \right\rangle \varepsilon_{11}^{*} + \left\langle c_{1133} - \frac{c_{1122}c_{2233}}{c_{2222}} \right\rangle \varepsilon_{33}^{*} + \\ + \left\langle c_{1113} - \frac{c_{1122}c_{2213}}{c_{2222}} \right\rangle \gamma_{13}^{*} + \left\langle \left(\frac{e_{\xi 311}c_{1122}}{c_{2222}} - e_{\xi 333}\sin^{2}\alpha_{1} - e_{\xi 311}\cos^{2}\alpha_{1} \right) \frac{U_{\text{con}}}{\Delta} \right\rangle \\ < \sigma_{33} >= \left\langle c_{3311} - \frac{c_{3322}c_{2211}}{c_{2222}} \right\rangle \varepsilon_{11}^{*} + \left\langle c_{3333} - \frac{c_{3322}c_{2233}}{c_{2222}} \right\rangle \varepsilon_{33}^{*} + \\ + \left\langle c_{3313} - \frac{c_{3322}c_{2213}}{c_{2222}} \right\rangle \gamma_{13}^{*} + \left\langle \left(\frac{e_{\xi 311}c_{3322}}{c_{2222}} - e_{\xi 333}\cos^{2}\alpha_{1} - e_{\xi 311}\sin^{2}\alpha_{1} \right) \frac{U_{\text{con}}}{\Delta} \right\rangle \\ < \tau_{13} >= \left\langle c_{1311} - \frac{c_{1322}c_{2211}}{c_{2222}} \right\rangle \varepsilon_{11}^{*} + \left\langle c_{1333} - \frac{c_{1322}c_{2233}}{c_{2222}} \right\rangle \varepsilon_{33}^{*} + \\ + \left\langle c_{1313} - \frac{c_{1322}c_{2213}}{c_{2222}} \right\rangle \gamma_{13}^{*} + \left\langle \left(\frac{e_{\xi 311}c_{1322}}{c_{2222}} + \frac{1}{2}(e_{\xi 333} - e_{\xi 311})\sin 2\alpha_{1} \right) \frac{U_{\text{con}}}{\Delta} \right\rangle \end{aligned}$$

или в виде

$$<\sigma_{11}>=\left(-\frac{}{c_{\xi 2222}}\right)\varepsilon_{11}^{*}+\\+\left(-\frac{}{c_{\xi 2222}}\right)\varepsilon_{33}^{*}+\left(-\frac{}{c_{\xi 2222}}\right)\gamma_{13}^{*}+\\+\frac{1}{\Delta}\left(e_{\xi 311}\frac{}{c_{\xi 2222}}-(e_{\xi 333}\sin^{2}\alpha_{1}+e_{\xi 311}\cos^{2}\alpha_{1})\right)$$

<u>ЖУРНАЛ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, eISSN 1684-1719, №8, 2024</u>

$$\begin{aligned} < \sigma_{33} >= \left(< c_{1133} > -\frac{< c_{1122} c_{3322} >}{c_{\xi 2222}} \right) \varepsilon_{11}^{*} + \\ + \left(< c_{3333} > -\frac{< c_{3322}^{2} >}{c_{\xi 2222}} \right) \varepsilon_{33}^{*} + \left(< c_{3313} > -\frac{< c_{3322} c_{1322} >}{c_{\xi 2222}} \right) \gamma_{13}^{*} + \\ + \frac{1}{\Delta} \left(e_{\xi 311} \frac{< U_{\text{con}} c_{3322} >}{c_{\xi 2222}} - < U_{\text{con}} > (e_{\xi 333} \cos^{2} \alpha_{1} + e_{\xi 311} \sin^{2} \alpha_{1}) \right) \\ < \tau_{13} >= \left(< c_{1311} > -\frac{< c_{1122} c_{1322} >}{c_{\xi 2222}} \right) \varepsilon_{11}^{*} + \\ + \left(< c_{3313} > -\frac{< c_{3322} c_{1322} >}{c_{\xi 2222}} \right) \varepsilon_{33}^{*} + \left(< c_{1313} > -\frac{< c_{1322}^{2} >}{c_{\xi 2222}} \right) \gamma_{13}^{*} + \\ + \frac{1}{\Delta} \left(e_{\xi 311} \frac{< U_{\text{con}} c_{1322} >}{c_{\xi 2222}} + \frac{1}{2} (e_{\xi 333} - e_{\xi 311}) \left\langle U_{\text{con}} \sin 2\alpha \right\rangle \right) \end{aligned}$$

Таким образом, приходим к выражениям

$$<\sigma_{11} >= \left(< c_{1111} > -\frac{< c_{1122}^{2} >}{c_{\xi 2222}}\right) \varepsilon_{11}^{*} + \\ + \left(< c_{1133} > -\frac{< c_{1122} c_{3322} >}{c_{\xi 2222}}\right) \varepsilon_{33}^{*} + \\ + \frac{1}{\Delta} \left(e_{\xi 311} \frac{< U_{con} c_{1122} >}{c_{\xi 2222}} - < U_{con} > (e_{\xi 333} \sin^{2} \alpha_{1} + e_{\xi 311} \cos^{2} \alpha_{1})\right) \\ < \sigma_{33} >= \left(< c_{1133} > -\frac{< c_{1122} c_{3322} >}{c_{\xi 2222}}\right) \varepsilon_{11}^{*} + \\ + \left(< c_{3333} > -\frac{< c_{3322}^{2} >}{c_{\xi 2222}}\right) \varepsilon_{33}^{*} + \\ + \frac{1}{\Delta} \left(e_{\xi 311} \frac{< U_{con} c_{3322} >}{c_{\xi 2222}} - < U_{con} > (e_{\xi 333} \cos^{2} \alpha_{1} + e_{\xi 311} \sin^{2} \alpha_{1})\right) \\ < \tau_{13} >= \left(< c_{1313} > -\frac{< c_{1322}^{2} >}{c_{\xi 2222}}\right) \gamma_{13}^{*} + \\ + \frac{1}{\Delta} \left(e_{\xi 311} \frac{< U_{con} c_{1322} >}{c_{\xi 2222}} + \frac{1}{2} (e_{\xi 333} - e_{\xi 311}) \left\langle U_{con} \sin 2\alpha \right\rangle\right)$$

с учетом осредненных величин

$$\langle U_{\rm con} c_{1122} \rangle = \langle U_{\rm con} \rangle (c_{(1)} \cos^2 \alpha_1 + c_{(3)} \sin^2 \alpha_1), \langle U_{\rm con} c_{3322} \rangle = \langle U_{\rm con} \rangle (c_{(1)} \sin^2 \alpha_1 + c_{(3)} \cos^2 \alpha_1), \langle U_{\rm con} c_{1322} \rangle = \frac{1}{2} (c_{(1)} - c_{(3)}) \langle U_{\rm con} \sin 2\alpha \rangle,$$

$$\langle U_{\rm con} \sin 2\alpha \rangle = \frac{U_{\rm con1} - U_{\rm con2}}{2} \sin 2\alpha_1, \\ \langle U_{\rm con} \rangle = \frac{U_{\rm con1} + U_{\rm con2}}{2};$$

$$(17)$$

$$< c_{1111} >= (c_{(1)} + 2c_{(5)})\cos^{4}\alpha_{1} + c_{(4)}\sin^{4}\alpha_{1} + (c_{(2)} + c_{(3)} + 4c_{(6)})\sin^{2}\alpha_{1}\cos^{2}\alpha_{1}$$

$$< c_{1122} >= c_{(1)}\cos^{2}\alpha_{1} + c_{(3)}\sin^{2}\alpha_{1}$$

$$< c_{1133} >= c_{(2)}\cos^{4}\alpha_{1} + c_{(3)}\sin^{4}\alpha_{1} + (c_{(1)} + c_{(4)} + 2c_{(5)} - 4c_{(6)})\sin^{2}\alpha_{1}\cos^{2}\alpha_{1}$$

$$< c_{1313} >= c_{(6)}\cos^{2}2\alpha_{1} + \frac{1}{4}(c_{(1)} - c_{(2)} - c_{(3)} + c_{(4)} + 2c_{(5)})\sin^{2}2\alpha_{1} \qquad (18)$$

$$< c_{3333} >= (c_{(1)} + 2c_{(5)})\sin^{4}\alpha_{1} + c_{(4)}\cos^{4}\alpha_{1} + (c_{(2)} + c_{(3)} + 4c_{(6)})\sin^{2}\alpha_{1}\cos^{2}\alpha_{1}$$

$$< c_{3333} >= (c_{(1)} + 2c_{(5)})\sin^{4}\alpha_{1} + c_{(4)}\cos^{4}\alpha_{1} + (c_{(2)} + c_{(3)} + 4c_{(6)})\sin^{2}\alpha_{1}\cos^{2}\alpha_{1}$$

$$< c_{1122}c_{3322} >= (c_{(1)}\cos^{2}\alpha_{1} + c_{(3)}\sin^{2}\alpha_{1})(c_{(1)}\sin^{2}\alpha_{1} + c_{(3)}\cos^{2}\alpha_{1})$$

$$< c_{3322}^{2} >= (c_{(1)}\sin^{2}\alpha_{1} + c_{(3)}\cos^{2}\alpha_{1})^{2}$$

$$< c_{1322}^{2} >= \frac{1}{4}(c_{(1)} - c_{(3)})^{2}\left\langle \sin^{2}2\alpha \right\rangle = \frac{1}{4}(c_{(1)} - c_{(3)})^{2}\sin^{2}2\alpha_{1}$$

при этом имеем нулевые значения для величин

$$< c_{1311} >= (c_{(2)} - c_{(4)} + 2c_{(6)}) < \sin^{3} \alpha \cos \alpha > + (c_{(1)} - c_{(3)} + 2c_{(5)} - 2c_{(6)}) < \sin \alpha \cos^{3} \alpha > = 0$$

$$< c_{3313} >= (c_{(1)} - c_{(2)} + 2c_{(5)} - 2c_{(6)}) \langle \sin^{3} \alpha \cos \alpha \rangle + (c_{(3)} - c_{(4)} + 2c_{(6)}) \langle \sin \alpha \cos^{3} \alpha \rangle = 0 \quad (19)$$

$$< c_{1122}c_{1322} >= \frac{1}{2}(c_{(1)} - c_{(3)}) \langle \sin 2\alpha (c_{(1)} \cos^{2} \alpha + c_{(3)} \sin^{2} \alpha) \rangle = 0$$

$$< c_{3322}c_{1322} >= \frac{1}{2}(c_{(1)} - c_{(3)}) \langle \sin 2\alpha (c_{(1)} \sin^{2} \alpha + c_{(3)} \cos^{2} \alpha) \rangle = 0$$

с учетом значений α_1 , $\alpha_2 = -\alpha_1$ ориентационного угла α и различных управляющих электрических напряжений U_{con1} , U_{con2} и для 1-го и 2-го слоев

актюатора. Блокирующие напряжения на сторонах прямоугольной двухслойной развертки CDS-актюатора

$$\sigma_{\bullet 11}^{*} = \frac{1}{\Delta} \Biggl(e_{\xi 311} \frac{\langle U_{\text{con}} c_{1122} \rangle}{c_{\xi 2222}} - \langle U_{\text{con}} \rangle (e_{\xi 333} \sin^{2} \alpha_{1} + e_{\xi 311} \cos^{2} \alpha_{1}) \Biggr),$$

$$\sigma_{\bullet 33}^{*} = \frac{1}{\Delta} \Biggl(e_{\xi 311} \frac{\langle U_{\text{con}} c_{3322} \rangle}{c_{\xi 2222}} - \langle U_{\text{con}} \rangle (e_{\xi 333} \cos^{2} \alpha_{1} + e_{\xi 311} \sin^{2} \alpha_{1}) \Biggr), \qquad (20)$$

$$\tau_{\bullet 13}^{*} = \frac{1}{\Delta} \Biggl(e_{\xi 311} \frac{\langle U_{\text{con}} c_{1322} \rangle}{c_{\xi 2222}} + \frac{1}{2} (e_{\xi 333} - e_{\xi 311}) \Biggl\langle U_{\text{con}} \sin 2\alpha \Biggr\rangle \Biggr)$$

найдем из формул (16) для случая $\varepsilon_{11}^* = \varepsilon_{33}^* = \gamma_{13}^* = 0$ с учетом осреднений (17). Радиальное u_r^* и продольное u_z^* смещения свободного кольцевого торца двухслойного CDS-актюатора –

$$u_r^* = \varepsilon_{\circ 11}^* R, \ u_z^* = \varepsilon_{\circ 33}^* h,$$
 (21)

при этом угол поворота $\Delta \varphi_z^* = 0$, где свободные деформации: $\varepsilon_{\circ 11}^*$, $\varepsilon_{\circ 33}^*$, $\gamma_{\circ 13}^*$ развертки для случая $\langle \sigma_{11} \rangle = \langle \sigma_{33} \rangle = \langle \tau_{13} \rangle = 0$ найдем (16) из решения системы двух линейных уравнений

$$\begin{split} & \left(< c_{1111} > -\frac{< c_{1122}^2 >}{c_{\xi 2222}} \right) \varepsilon_{11}^* + \left(< c_{1133} > -\frac{< c_{1122} c_{3322} >}{c_{\xi 2222}} \right) \varepsilon_{33}^* = \\ & = -\frac{1}{\Delta} \left(e_{\xi 311} \frac{< U_{\text{con}} c_{1122} >}{c_{\xi 2222}} - < U_{\text{con}} > (e_{\xi 333} \sin^2 \alpha_1 + e_{\xi 311} \cos^2 \alpha_1) \right) \\ & \left(< c_{1133} > -\frac{< c_{1122} c_{3322} >}{c_{\xi 2222}} \right) \varepsilon_{11}^* + \left(< c_{3333} > -\frac{< c_{3322}^2 >}{c_{\xi 2222}} \right) \varepsilon_{33}^* = \\ & = -\frac{1}{\Delta} \left(e_{\xi 311} \frac{< U_{\text{con}} c_{3322} >}{c_{\xi 2222}} - < U_{\text{con}} > (e_{\xi 333} \cos^2 \alpha_1 + e_{\xi 311} \sin^2 \alpha_1) \right) \end{split}$$

при этом сдвиговая деформация

$$\gamma_{13}^{*} = -\frac{e_{\xi 311} \frac{\langle U_{\text{con}} c_{1322} \rangle}{c_{\xi 2222}} + \frac{1}{2} (e_{\xi 333} - e_{\xi 311}) \langle U_{\text{con}} \sin 2\alpha \rangle}{\Delta \left(\langle c_{1313} \rangle - \frac{\langle c_{1322}^{2} \rangle}{c_{\xi 2222}}\right)}$$

с учетом (17), (18).

2.4 Традиционные пленочные актюаторы. Для традиционного пьезоэлектрического актюатора, подобного развертке (рис. 3а) или самому цилиндрическому CDS-актюатору (рис. 3б), но с расположением поверхностных электродов на внутренней и внешней цилиндрических поверхностях тонкого однородного пьезоэлектрического цилиндрического слоя толщиной h_a или $h_a^* = 2h_a$ и с поляризацией по толщине слоя имеем определяющие соотношения для напряжений -

$$\sigma_{11} = c_{\xi 11} \varepsilon_{11} + c_{\xi 13} \varepsilon_{22} + c_{\xi 12} \varepsilon_{33} - e_{\xi 311} \frac{U_{\text{con}}}{h_a},$$

$$\sigma_{33} = c_{\xi 12} \varepsilon_{11} + c_{\xi 13} \varepsilon_{22} + c_{\xi 11} \varepsilon_{33} - e_{\xi 311} \frac{U_{\text{con}}}{h_a},$$

$$\tau_{13} = 0$$
(22)

с учетом равенства

$$\sigma_{22} = c_{\xi_{13}}\varepsilon_{11} + c_{\xi_{33}}\varepsilon_{22} + c_{\xi_{13}}\varepsilon_{33} - e_{\xi_{333}}\frac{U_{\text{con}}}{h_a} = 0$$
(23)

для рассматриваемого плоского напряженного состояния. Из (23) получим выражение деформации

$$\varepsilon_{22} = \frac{1}{c_{\xi_{33}}} \left(e_{\xi_{333}} \frac{U_{\text{con}}}{h_a} - c_{\xi_{13}} \varepsilon_{11} - c_{\xi_{13}} \varepsilon_{33} \right)$$
(24)

после подстановки (24) в (22) получим формулы

$$\sigma_{11} = \left(c_{\xi_{11}} - c_{\xi_{13}} \frac{c_{\xi_{13}}}{c_{\xi_{33}}}\right) \varepsilon_{11} + \left(c_{\xi_{12}} - c_{\xi_{13}} \frac{c_{\xi_{13}}}{c_{\xi_{33}}}\right) \varepsilon_{33} + \left(e_{\xi_{333}} \frac{c_{\xi_{13}}}{c_{\xi_{33}}} - e_{\xi_{311}}\right) \frac{U_{\text{con}}}{h_a},$$

$$\sigma_{33} = \left(c_{\xi_{12}} - c_{\xi_{13}} \frac{c_{\xi_{13}}}{c_{\xi_{33}}}\right) \varepsilon_{11} + \left(c_{\xi_{11}} - c_{\xi_{13}} \frac{c_{\xi_{13}}}{c_{\xi_{33}}}\right) \varepsilon_{33} + \left(e_{\xi_{333}} \frac{c_{\xi_{13}}}{c_{\xi_{33}}} - e_{\xi_{311}}\right) \frac{U_{\text{con}}}{h_a},$$
(25)

что соответствует блокирующим значениям напряжений

$$\bar{\sigma}_{\bullet 11} = \left(e_{\xi 333} \frac{c_{\xi 13}}{c_{\xi 33}} - e_{\xi 311} \right) \frac{U_{\text{con}}}{h_a}, \ \bar{\sigma}_{\bullet 33} = \left(e_{\xi 333} \frac{c_{\xi 13}}{c_{\xi 33}} - e_{\xi 311} \right) \frac{U_{\text{con}}}{h_a}, \ \tau_{\bullet 13} = 0$$
(26)

блокирующие усилия для развертки -

$$\overline{P}_{\bullet 1} = h_a l_3 \overline{\sigma}_{\bullet 11}, \ \overline{P}_{\bullet 3} = h_a l_1 \overline{\sigma}_{\bullet 33}$$
(27)

Свободные деформации $\bar{\varepsilon}_{\circ 11}$, $\bar{\varepsilon}_{\circ 33}$ для развертки найдем из уравнений (25) для случая $\sigma_{11} = \sigma_{22} = 0$ или по формулам

$$\overline{\varepsilon}_{\circ 11} = d_{\xi 311} \frac{U_{\text{con}}}{h_a}, \ \overline{\varepsilon}_{\circ 33} = d_{\xi 311} \frac{U_{\text{con}}}{h_a},$$

что соответствует радиальному и продольному перемещениям

$$\overline{u}_r = R\overline{\varepsilon}_{\circ 11}, \ \overline{u}_z = h\overline{\varepsilon}_{\circ 33} \tag{28}$$

свободного кольцевого торца тонкой цилиндрической оболочки традиционного актюатора. Для случая $h_a^* = 2h_a$ соответствующие перемещения \overline{u}_r^* , \overline{u}_z^* , блокирующие напряжения $\overline{\sigma}_{\bullet 11}^*$, $\overline{\sigma}_{\bullet 33}^*$ и усилия $\overline{P}_{\bullet 1}^*$, $\overline{P}_{\bullet 3}^*$ для развертки также рассчитываем по формулам (26) – (28) с заменой толщины h_a на $2h_a$.

3. Результаты численного моделирования

На рис. 4, рис. 5 в виде графиков представлены результаты вычислений деформационных характеристик: радиального u_r , продольного u_z смещений и поворота $\Delta \phi_z$ кольцевого торца однослойного (рис. 4) и двухслойного (рис. 5) CDS-актюаторов в зависимости от угла подъема *а* витков спирали электродов. Выявлена существенная немонотонность зависимости деформационных и блокирующих характеристик CDS-актюаторов от угла подъема α витков спирали электродов. Так, для однослойного CDS-актюатора для продольных смещений *u_z* вдоль оси актюатора (рис. 4a) максимальные значения достигаются при значении угла $\alpha = 0$ электродов, что соответствует углу поляризации $\alpha_p = \pi / 2$, т.е. направлению поляризации в продольном направлении z. В общем, для зависимостей смещений u_r , u_z от угла α (рис. 4a) точками экстремума являются значения $\alpha = 0$, $\pi / 2$, что соответствует углам поляризации $\alpha_p = \pi / 2$, 0 в продольном ($\alpha_p = \pi / 2$) и окружном ($\alpha_p = 0$) направлениях. Максимальные по модулю повороты $\Delta \varphi_z$ (рис. 4б) кольцевого торца однослойного CDS-актюатора реализуются при значениях углов витков электродов $\alpha = \pm \pi / 4$ и поляризации $\alpha_p = \mp \pi / 4$ соответственно, при этом

смена знака (направления) поворота $\Delta \varphi_z$ вокруг продольной оси *z* происходит как при смене знака углов α , α_p , так и управляющего электрического напряжения U_{con} на выходах электродов. Равенство нулю поворота $\Delta \varphi_z$ кольцевого торца однослойного CDS-актюатора имеем лишь при значениях угла $\alpha = 0$, $\pi / 2$ (рис. 46).



Рис. 4. Радиальное u_r и продольное u_z смещения (а) и поворот $\Delta \varphi_z$ (б) кольцевого торца однослойного CDS-актюатора в зависимости от угла подъема α витков спирали электродов при $U_{con} = 1000$ В (сплошные линии), -1000 В (пунктирные линии).



Рис. 5. Радиальное u_r (\circ), продольное u_z (Δ) смещения и поворот $\Delta \varphi_z$ (\Box) кольцевого торца двухслойного CDS-актюатора в зависимости от угла α_1 для случаев: $U_{con2} = U_{con1}$ (a), $U_{con2} = -U_{con1}$ (б) при $U_{con1} = 1000$ В.



Рис. 6. Блокирующие напряжения $\sigma_{\bullet 11}$ (\circ), $\sigma_{\bullet 33}$ (Δ), $\tau_{\bullet 13}$ (\Box) на сторонах прямоугольной однослойной CDS-развертки в зависимости от угла α при $U_{\rm con} = 1000$ В.



Рис. 7. Блокирующие напряжения $\sigma_{\bullet 11}^*$ (\circ), $\sigma_{\bullet 33}^*$ (Δ), $\tau_{\bullet 13}^*$ (\Box) на сторонах прямоугольной двухслойной CDS-развертки в зависимости от угла α_1 для случаев: $U_{con2} = U_{con1}$ (a), $U_{con2} = -U_{con1}$ (б) при $U_{con1} = 1000$ В.

Для двухслойного CDS-актюатора (рис. 5) с симметричным относительно продольной оси z расположением витков различных слоев (- однослойных CDSактюаторов) для случая $U_{con2} = U_{con1}$ имеем лишь отличные от нуля продольные u_z и радиальные u_r смещения при равенстве нулю поворота $\Delta \varphi_z = 0$ (рис. 5а), а для случая $U_{\rm con2} = -U_{\rm con1}$ отличным от нуля является лишь поворот $\Delta \varphi_z$ (рис. 5б). При одновременной смене знака обоих управляющих напряжений U_{con1} , U_{con2} изменяется знак величин u_r , u_z (рис. 5а) и $\Delta \varphi_z$ (рис. 5б). блокирующих характеристик осуществлено через Вычисление расчет напряжений $\sigma_{\bullet 11}^*, \sigma_{\bullet 33}^*, \tau_{\bullet 13}^*$ на внешнем контуре – сторонах прямоугольной однослойной (рис. 1a, рис. 6) и двухслойной (рис. 7) развертки CDS-актюатора в зависимости от ориентационного угла *α* электродов. Для однослойной CDSразвертки (рис. 6), в общем, все блокирующие напряжения $\sigma_{\bullet 11}, \sigma_{\bullet 33}, \tau_{\bullet 13}$ отличны от нуля, при этом для двухслойной CDS-развертки (рис. 7) имеем $au_{\bullet 13}^* = 0$ для случая $U_{con2} = U_{con1}$ (рис. 7а) и $\sigma_{\bullet 11}^* = \sigma_{\bullet 33}^* = 0$ для случая $U_{con2} = -U_{con1}$ (рис. 7б). На рис. 8, рис. 9 представлены первые три собственные формы колебаний однослойного (табл. 1, рис. 8) и двухслойного (табл. 2, рис. 9) CDS-актюаторов при значениях углов поляризации $\alpha_p = \pi/3$ и подъема спирали электродов $\alpha = -\pi/6$ однослойного актюатора, а для двухслойного – углы поляризации: $\alpha_{p1} = \pi / 3$, $\alpha_{p2} = 2\pi / 3$ при $\alpha_{1,2} = \alpha_{p1,2} - \pi / 2$ для 1-го и 2-го слоев; значения резонансных (собственных) частот для этих форм колебаний даны в табл. 1, табл. 2.







двухслойного CDS-актюатора.

Таблица 1. Собственные частоты н	колебаний	однослойного	CDS-актюатора.
----------------------------------	-----------	--------------	----------------

Угол поляризации	Собственная частота, Гц			
$\alpha_{\mathbf{p}},$ °	1	2	3	
60	1765.1	2668.2	4161.6	

Таблица 2. Собственные частоты колебаний двухслойного CDS-актюатора

Углы поляризаций		Собственная частота, Гц		
$\alpha_{\mathbf{p}_1},$ °	$\alpha_{\mathtt{p2}},^{\circ}$	1	2	3
60	120	2328.1	2464.5	5398.5

Заключение

Представлено устройство пьезоэлектрического CDS-актюатора [17] в пьезоэлектрической (рис. 1б) виде цилиндрической оболочки с расположенными на поверхности двойными цилиндрическими спиралями с углом подъема α линейных электродов. Поляризация пьезоэлектрического слоя осуществляется посредством подключения к выходам спиралей электродов поляризующего значения электрического напряжения U_{con}, что обуславливает периодические взаимообратные поляризации (рис. 2) на локальных участках пьезоэлектрического слоя между электродами вдоль «линии поляризации» спирали, ортогональной спиралям электродов. Предложен способ [18] изготовления пьезоэлектрического CDS-актюатора [17] через предварительное создание развертки CDS-актюатора в виде гибкого планарного прямоугольного актюатора расположением взаимодействующих пьезоэлектрического с прямолинейных «встречно-гребенчатых» электродов под углом а к основанию CDS-развертки (рис. 1a). CDS-развертка сворачивается в цилиндрическую оболочку (рис. 1б) с установкой, например, на поверхности упругого вала в качестве подложки. Осуществлено численное моделирование (рис. 4 – рис. 9) деформационных полей CDS-развертки и CDS-актюатора, модальный анализ первых трех форм и резонансных частот колебаний для случаев однослойного и двухслойного актюаторов.

Финансирование: Результаты получены при выполнении государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на выполнение фундаментальных научных исследований (проект № FSNM-2023-0006).

Литература

- Zhu D., Almusallam A., Beeby S.P., Tudor J., Harris N.R. A bimorph multi-layer piezoelectric vibration energy harvester // PowerMEMS 2010 Proceedings. Belgium, Leuven. 2010. P. 1–4.
- Williams C.B., Yates R.B. Analysis of a microelectric generator for Microsystems // Sensors and Actuators A: Physical. 1996. V. 52. No. 1-3. P. 8–11.
- Liu H., Zhong J., Lee C., Lee S.-W., Lin L. A comprehensive review on piezoelectric energy harvesting technology: Materials, mechanisms, and applications // Applied Physics Reviews. 2018. V. 5. No. 4. P. 041306. https://doi.org/10.1063/1.5074184
- Ivan I.A., Rakotondrabe M., Lutz P., Chaillet N. Quasistatic displacement selfsensing method for cantilevered piezoelectric actuators // Review of Scientific Instruments. American Institute of Physics. 2009. V. 80. No. 6. P. 065102-1/065102-8. https://doi.org/10.1063/1.3142486
- Bansevičius R., Navickaitė S., Jūrėnas V., Mažeika D., Lučinskis R., Navickas J. Investigation of novel design piezoelectric bending actuators // Journal of Vibroengineering. 2013. V. 15. No. 2. P. 1064–1068.
- 6. Патент РФ № 2099754. Йелстаун Корпорейшн Н.В. Деформируемое зеркало на основе многослойной активной биморфной структуры. Дата заявки: 17.10.1996. Дата публикации: 20.12.1997. 7 с. URL: https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet
- Mouhli M. Analysis and shape modeling of thin piezoelectric actuators. Virginia Commonwealth University Publ., 2005. 100 p.
- Yamada H., Sasaki M., Nam Y. Active vibration control of a micro-actuator for hard disk drives using self-sensing actuator // Journal of Intelligent Material Systems and Structures. 2008. V. 19. No. 1. P. 113–123. https://doi.org/10.1177/1045389X07083693
- El-Sayed A.M., Abo-Ismail A., El-Melegy M.T., Hamzaid N.A., Osman N.A.A. Development of a micro-gripper using piezoelectric bimorphs // Sensors. 2013.
 V. 13. P. 5826–5840. https://doi.org/10.3390/s130505826

- Zhou J., Dong L., Yang W.A Double-Acting Piezoelectric actuator for helicopter active rotor // Actuators. 2021. No. 10(247). P. 1–15. https://doi.org/10.3390/act10100247
- Abedian B., Cundari M. Resonant frequency of a polyvinylidene flouride piezoelectric bimorph: the effect of surrounding fluid // Proceedings Smart Structures and Materials. 1993. V. 1916: Smart Materials. 23 July 1993. https://doi.org/10.1117/12.148486
- Патент РФ № 2723567. Лопасть воздушного винта с управляемой геометрией профиля / Паньков А.А., Аношкин А.Н., Писарев П.В. Дата заявки: 18.11.2019. Дата публикации: 16.06.2020. 5 с. URL: https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet
- Patent US 2003/0056351 A1. Piezoelectric Macro-Fiber Composite Actuator and Method for Making Same / Wilkie W.K., et al. Application Publ. March 27, 2003.
- 14. Emad D, Fanni MA, Mohamed AM, Yoshida S. Low-Computational-Cost Technique for Modeling Macro Fiber Composite Piezoelectric Actuators Using Finite Element Method // Materials (Basel). 2021. No. 14(15). P. 4316.
- Park J.-S., Kim J.-H. Analytical development of single crystal Macro Fiber Composite actuators for active twist rotor blades // Smart Mater. Struct. 2005. No. 14. P. 745–753. doi:10.1088/0964-1726/14/4/033
- Патент RU № 2803015. Пьезоэлектрический MDS-актюатор / Паньков А.А., опубл.: 05.09.2023 Бюл. № 25, заявка № 2023109123 от 11.04.2023 г.
- 17. Патент RU № 2801619. Пьезоэлектрический CDS-актюатор / Паньков А.А., опубл.: 11.08.2023 Бюл. № 23, заявка № 2023111440 от 03.05.2023 г.
- 18. Патент RU № 2811420. Способ изготовления пьезоэлектрического актюатора / Паньков А.А., опубл.: 11.01.2024 Бюл. № 2, заявка № 2023127236 от 24.10.2023 г.
- Dong X.-J., Meng G. Dynamic analysis of structures with piezoelectric actuators based on thermal analogy method // International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2006. V. 27. P. 841–844. doi:10.1007/s00170-004-2290-5

Для цитирования:

Паньков А.А. Электроупругость пьезоэлектрического пленочного актюатора с системой взаимодействующих встречно-гребенчатых электродов. // Журнал радиоэлектроники. – 2024. – № 8. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2024.8.8